



Kursplan

för kurs på avancerad nivå

Nanoteknologi
Nanoscale Technology

7.5 Höskolepoäng
7.5 ECTS credits

Kurskod:	FK7018
Gäller från:	VT 2008
Fastställt:	2006-09-27
Ändrad:	2007-11-19
Institution	Fysikum
Ämne	Fysik
Fördjupning:	A1N - Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Beslut

Denna kursplan är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 2006-09-27 och reviderad 2007-11-19.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Kvantmekanik II, GN, 7,5 hp (FK5012). Engelska B eller motsvarande.

Kursens uppläggning

Provkod	Benämning	Höskolepoäng
1100	Nanoteknologi	7.5

Kursens innehåll

Kursen beskriver de mest förekommande processerna och materialen inom mikrofäbrikation (fotolitografi, olika typer av deponering och etsning av tunna filmer), de mest avancerade nanofäbrikationsprocesserna (elektronstrålelitografi och etsning med hjälp av fokuserad jonstråle) och olika karakteriseringsmetoder och renrumsutrustning. Kursen behandlar fysiken bakom mikro/nanoteknologi (vakuum, plasma, elektronoptik, materialvetenskap, m m) och ger en överblick över den aktuella nanoforskningen och pågående utveckling av processer och material inom mikro/nanoteknologin.

De kunskaper som kursen förmedlar är användbara för lärare samt för personer verksamma i yrkesområden som hanterar avancerade frågeställningar och konstruktionsuppgifter inom mikroelektronik, materialfysik och datorteknologi. Kursen kan fungera som en bas för framtida nanoteknologispecialister genom att den förmedlar en förståelse för den grundläggande fysiken för nanotillverkning och nanostrukturer.

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten:

- förstå och kunna beskriva samband i kedjan: Process – Struktur – Egenskaper – Prestanda för tunnfilmskomponenter
- kunna välja lämpliga material, samt ändamålsenliga deponerings- och karakteriseringstekniker för några vanliga tunnfilmstillämpningar
- kunna beskriva hur valet av processparametrar påverkar tunnfilmsegenskaper samt utföra enkla beräkningar av sådana parametrar för att uppnå bestämda egenskaper
- kunna demonstrera såväl teoretisk som praktisk kunskap om olika mikro- och nanofäbrikationsmetoder som används inom VLSI-teknologi (VLSI står för Very Large Scale Integration),

mikroelektronik och mikromaskintillverkning

- kunna redogöra för hur renrumsutrustning fungerar samt kunna demonstrera en viss kännedom om aktuell utveckling och forskning inom nanoteknologins område

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, inlämningsuppgifter och en litteraturuppgift.

Deltagande i laborationer är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning.

Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras på följande vis: kunskapskontroll sker genom skriftligt och/eller muntligt prov och laborationsredovisningar samt genom inlämningsuppgifter.

b. Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygskala:

A = Utmärkt

B = Mycket bra

C = Bra

D = Tillfredsställande

E = Tillräckligt

Fx = Otillräckligt

F = Helt Otillräckligt

c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.

d. För godkänt krävs lägst betygsgraden E samt deltagande i all obligatorisk undervisning.

e. Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå minst fyra ytterligare prov så länge kursen ges. Med prov jämsställs också andra obligatoriska kursdelar. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på prov två gånger har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

Studerande kan begära att examination genomförs enligt denna kursplan även efter det att den upphört att gälla, dock högst tre gånger under en tvåårsperiod efter det att undervisning på kursen upphört. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.

Övrigt

Kursen kan ingå i masterprogrammen i fysik men kan också läsas som fristående kurs.

Kurslitteratur

Kurslitteratur beslutas av institutionsstyrelsen och redovisas därefter i bilaga till kursplanen.